

Dataphysics OCA

Kontaktwinkelmessung

Ermöglicht die Untersuchung des Benetzungsverhalten von Proben bei Hochvakuum durch automatisierte Kontaktwinkelmessung. Zeitverläufe können als Film wiedergegeben werden.

Dimension DI-3100

AFM

Industrielles Rasterkraftmikroskop, das durch die Bedienung an Luft und Auflösung oberhalb atomaren Maßstabs die Untersuchung eines sehr breiten Probenspektrums ermöglicht.

FEI Helios Nanolab 600

REM, EDX, EBSD, STEM

Rasterelektronenmikroskop mit der Möglichkeit zu EDX, EBSD, STEM (an dünnen Proben) sowie Querschnittsuntersuchungen durch FIB (Kratererzeugung mittels Ionenbeschuss).

HOSITRAD MGT

QMS

Ermöglicht die Untersuchung des Ausgasverhaltens von Proben bei frei wählbaren Temperaturen mittels QMS im Hochvakuum.

Keyence VK-X210

CLSM

Konfokales Laserrastermikroskop, das die Aufnahme von hochauflösenden Weitfeldmikroskopiebildern ermöglicht, aber auch topographische Informationen mit einer Auflösung von wenigen Nanometern erlaubt.

Omicron NanoSAM

REM, AES

Kombination aus Rasterelektronenmikroskop und Auger-Mikrosonde, die nicht nur die Abbildung durch REM, sondern auch die Ermittlung der chemischen Zusammensetzung durch Auger-Elektronenspektroskopie ermöglicht.

Omicron Multiprobe

XPS, UPS, AES, AFM, STM

Ultrahochvakuum-Analysesystem, welches die Untersuchung der chemischen (mittels XPS, UPS, AES) und topographischen (mittels AFM und STM) Eigenschaften einer Probe ermöglicht.

SPECS UHV-XPS/SPM

XPS, STM, AFM

Ultrahochvakuum-Analysesystem, welches die Ermittlung der chemischen Zusammensetzung durch XPS und der topographischen Oberflächenbeschaffenheit durch STM und AFM ermöglicht.

UHV-Spektroskopie I und II

XPS, MIES, UPS

Ultrahochvakuum-Analysesysteme, die mittels XPS, MIES und UPS die chemische Analyse von Proben ermöglichen, aber mit Plasmabehandlungen und PVD/ CVD auch Präparationen im UHV bieten.

